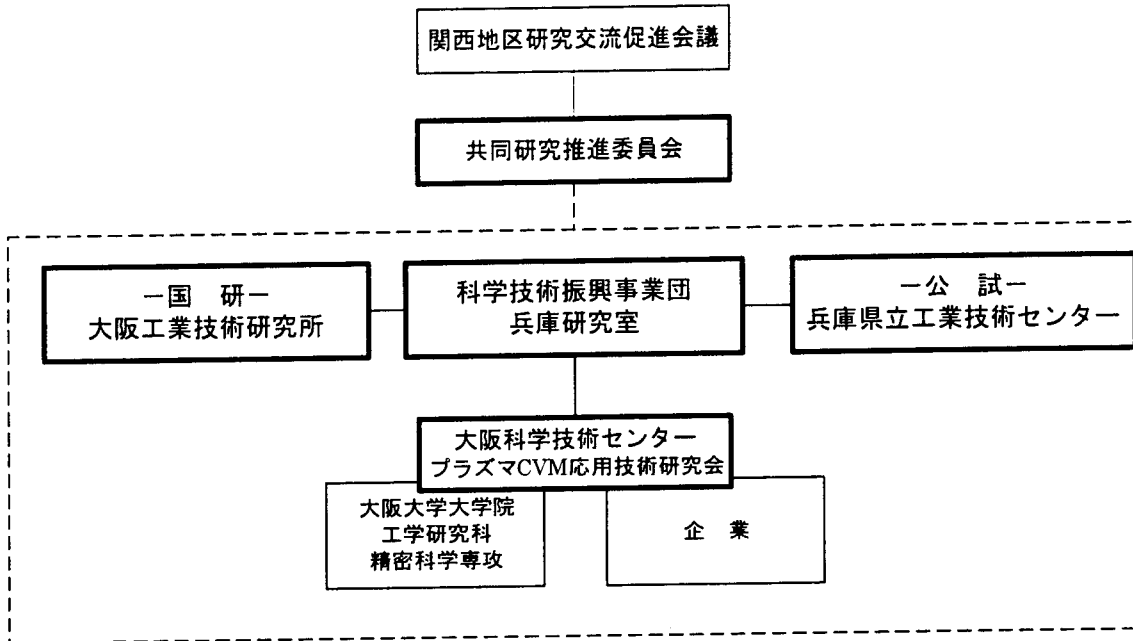


・研究体制

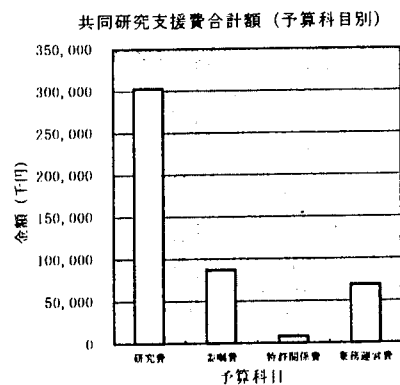
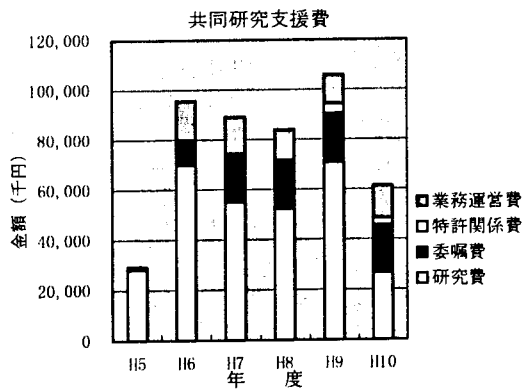


2. 共同研究運営の概要

2.1 事業運営経費

(単位：千円)

年度	H5	H6	H7	H8	H9	H10	合計
研究費	28,125	69,752	54,835	52,255	70,588	26,561	302,113
委嘱費	0	10,081	18,794	18,515	19,720	19,024	86,134
特許関係費	0	0	703	817	3,872	2,670	8,062
業務運営費	1,152	15,683	14,670	12,304	11,470	13,075	68,353
共同研究支援費 合計	29,277	95,516	89,002	83,891	105,650	61,330	464,662



この他、平成7年度補正予算（総額 430,000 千円）で、数値制御 EEM 加工機等合計 7 件の装置を試作した。

## 2.2 主要研究設備一覧

装 置 名 称
プラズマ CVM 実験装置
プログラム開発用ワークステーション
カラープリンタ 動画製作装置
インターネット LAN
デジタルリアルタイムオシロスコープ
高出力高周波電源
アクティブ除振装置
クリーンブース
超高真空 STM 試作研究装置・超高真空対応
特殊微粒子計測装置
フーリエ変換赤外分光装置
標準ガス発生機
プラズマ CVM 装置
高周波電源装置
ネットワークアナライザ・校正キット
プラズマ CVM 加工機一式 (NC 制御装置、チャンパー、高周波電源、 CVM 装置本体他)
数値制御 EEM 加工機一式 (超純水精製循環装置、EEM 加工機本体)
微粒子生成装置一式 (微粒子生成装置、ガス供給装置、ガス循環冷却生成装置他)
a-SiC 成膜装置一式
加工液精製循環装置一式
微粒子径計測装置

## 2.3 研究推進メンバー

### (1) 共同研究推進委員会

平成 10 年 12 月 4 日現在

	機 関	所属・役職	氏 名
委員長	大阪大学	大学院工学研究科精密科学専攻教授	森 勇藏
委員	工業技術院大阪工業技術研究所	光機能材料部長	竹中啓恭
〃	兵庫県立工業技術センター	機械金属工業指導所所長	脇坂彰一
〃	(財)大阪科学技術センター	専務理事	辻 勝之
〃	科学技術振興事業団	理事	井上邦弘
〃	大阪大学	大学院工学研究科精密科学専攻教授	芳井熊安
〃	大阪大学	大学院工学研究科精密科学専攻教授	片岡俊彦
〃	大阪大学	大学院工学研究科精密科学専攻教授	広瀬喜久治
〃	(株)新潟鉄工所	企画室開発センター長	徳永彰久
〃	住友電気工業(株)	伊丹研究所長	野村俊雄
〃	科学技術振興事業団	理事	山路順一
〃	科学技術振興事業団	研究交流・支援促進室長	板山和彦

## (2) 工業技術院大阪工業技術研究所

所 属	役 職	氏 名	共同研究参画期間
光機能材料部	部長	山下博志	H6.3～H9.3
〃	〃	中村 治	H9.4～H10.3
〃	〃	竹中啓恭	H10.4～H11.2
光機能材料部	室長	松岡克典	H6.3～H11.2
〃 情報光学研究室	主任研究官	大谷和男	H6.3～H11.2
〃	〃	中島一敏	H6.3～H11.2

注) 共同研究の期間は、H6.3～H11.2です。

## (3) 兵庫県立工業技術センター

所 属	役 職	氏 名	共同研究参画期間
機械金属工業指導所	所長	沖田耕三	H6.3～H9.3
〃	〃	脇坂彰一	H9.4～H11.2
〃	研究員	柴原正文	H6.3～H11.2

## (4) (財) 大阪科学技術センター (プラズマ CVM 応用技術研究会)

機関名	所 属・役 職	氏 名	共同研究参画期間
大阪大学大学院	工学研究科精密科学専攻教授	森 勇藏	H6.3～H11.2
〃	〃	芳井熊安	H6.3～H11.2
〃	〃	片岡俊彦	H6.3～H11.2
〃	〃	広瀬喜久治	H6.3～H11.2
兵庫県立工業技術センター	機械金属工業指導所研究員	柴原正文	H6.3～H11.2
科学技術振興事業団	プロジェクト部長	林 俊一	H6.3～H11.2
岡崎・西澤国際特許事務所		西澤利夫	H6.3～H11.2
(株) 新潟鉄工所	製品開発部部長	佐藤正彦	H6.3～H11.2
〃	材料構造研究部部長	白鳥征也	H6.3～H11.2
(株) フジキン	大阪ハイテック研究所主位	川田幸司	H6.3～H11.2
〃	大阪ハイテック研究所代表技師	池田信一	H6.3～H11.2
日東電工 (株)	基幹技術センター	小田高司	H6.3～H7.3
三洋電機 (株)	太陽電池研究室長	西脇秀則	H6.3～H7.8
〃	〃	中村 昇	H7.8～H11.2
松下電器産業 (株)	デバイスエンジニアリング開発センター主任技師	富田佳宏	H6.3～H10.3
旭硝子 (株)	ニューガラス開発研究所	清水智之	H6.3～H7.3
セントラル硝子 (株)	化学研究所主席研究員	中川伸介	H6.3～H9.3
(株) ニコン	第三技術開発部課長	柴田規夫	H7.4～H10.3
シャープ (株)	生産技術開発センター所長	奥田 徹	H7.4～H11.2
日本ピラー工業 (株)	市場開発部次長	谷野吉弥	H9.3～H10.3

## (5) 科学技術振興事業団兵庫研究室

職 名	氏 名	在任期間	在任期間終了後の所属
研究主任	坂本正雄	H6.3～H8.1	大阪大学
	石川俊夫	H7.12～H11.2	
研 究 員	堤 建一	H6.12～H11.2	日本電子 (株)
	岡田浩巳	H8.4～H11.2	大阪大学
事務参事	大嶋 健	H6.3～H9.3	(財) 大阪科学技術センター
	芝本亘司	H9.4～H11.2	〃
事 務 員	長尾吉美	H6.3～H8.6	〃
	中山幸子	H8.7～H11.2	〃

(6) 研究指導者

所 属	役 職	氏 名	共同研究参画期間
大阪大学大学院 工学研究科精密科学専攻	教授	森 勇藏	H6.3~H11.2
〃	〃	芳井熊安	〃
〃	〃	広瀬喜久治	〃
〃	〃	片岡俊彦	〃
〃	〃	森田瑞穂	H8.4~H11.2
〃	助教授	安武 潔	H6.3~H11.2
〃	〃	遠藤勝義	〃
〃	〃	山内和人	〃
〃	講師	杉山和久	〃
〃	助手	垣内弘章	〃
〃	〃	山村和也	〃
〃	〃	佐野泰久	〃
〃	〃	稲垣耕司	〃
京都工芸繊維大学	助教授	後藤英和	〃

2.4 研究活動

(1) 共同研究推進委員会開催記録

開催	開催日	議 題	提出資料
第1回	平成6年9月28日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・新技術事業団挨拶</li> <li>・委員紹介</li> <li>・委員長選出</li> <li>・委員長挨拶</li> <li>・共同研究等促進事業について</li> <li>・共同研究計画(案)について</li> <li>・その他</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・委員名簿、出席者名簿</li> <li>・新技術事業団パンフレット</li> <li>・共同研究計画書(案)</li> <li>同、参考資料</li> <li>・共同研究推進委員会の運営について</li> </ul>
第2回	平成7年7月21日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・委員長挨拶</li> <li>・新委員紹介</li> <li>・平成6年度研究報告</li> <li>・平成7年度研究計画</li> <li>・総合討議</li> <li>・その他</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・委員名簿、出席者名簿</li> <li>・共同研究推進計画</li> <li>・平成6年度研究報告、平成7年度研究計画</li> <li>・研究報告書の構成</li> </ul>
第3回	平成8年9月9日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・研究委託中間報告</li> <li>・その他</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・新技術事業団共同研究推進委員会資料(秘)</li> </ul>
第4回	平成10年12月4日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・共同研究の終了について</li> <li>・研究終了報告書の執筆内容について</li> <li>・その他</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・</li> </ul>

(2) 兵庫研究室活動記録

兵庫研究室活動記録																														
項目	H6年				H7年				H8年				H9年				H10年				H11									
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2						
設備	プラズマCVM実験装置移設工事				三次元超高速画像処理装置				プラズマCVM汎用実験装置 圧縮暴立(電圧技術センター分)				高周波電源装置				STM装置				高周波電源装置改良 CVM改良 アクリノブ群振装置設置 クリーンブース設置 ガンマオキシサ取付				試料作製室				高電圧極限ハルス電源装置	
報告	第1回推進委員会				第2回推進委員会				第3回推進委員会 補正予第中間報告会												第4回推進委員会									
特許出願																														